

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МИ ВлГУ

А.Л. Жизняков

Календарный учебный график
по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование
год набора 2024
заочная форма обучения (на базе СПО)

Мес	Сентябрь				Октябрь				Ноябрь				Декабрь				Январь				Февраль				Март				Апрель				Май				Июнь				Июль				Август																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Нед	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
I										*									*								*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

- теоретическое обучение

Э

 - экзаменационные сессии

У

 - учебная практика

П

 - производственная практика

- выпускная квалификационная работа, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

К

 - каникулы

*

 - нерабочие праздничные дни